

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6776777号  
(P6776777)

(45) 発行日 令和2年10月28日 (2020.10.28)

(24) 登録日 令和2年10月12日 (2020.10.12)

(51) Int.Cl.

A 6 1 B 3/10 (2006.01)

F 1

A 6 1 B 3/10 300

請求項の数 9 (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2016-194514 (P2016-194514)  
 (22) 出願日 平成28年9月30日 (2016.9.30)  
 (65) 公開番号 特開2017-64407 (P2017-64407A)  
 (43) 公開日 平成29年4月6日 (2017.4.6)  
 審査請求日 令和1年8月10日 (2019.8.10)  
 (31) 優先権主張番号 特願2015-195448 (P2015-195448)  
 (32) 優先日 平成27年9月30日 (2015.9.30)  
 (33) 優先権主張国・地域又は機関  
日本国 (JP)

(73) 特許権者 000135184  
株式会社ニデック  
愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14  
 (72) 発明者 佐々木 譲治  
愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14 株式会社ニデック拾石工場内  
 (72) 発明者 羽根瀬 昌明  
愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14 株式会社ニデック拾石工場内

審査官 増渕 俊仁

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】眼底撮影装置

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

光源からの光を被検眼の眼底上で走査するために前記光の進行方向を変える光スキャナを有する走査光学系と、

前記光スキャナと前記被検眼との間に配置され、前記光スキャナからの前記光を前記眼底に導くための対物光学系と、を有し、前記光の眼底反射光に基づいて前記眼底の画像を形成する眼底撮影装置であって、

前記対物光学系は、

前記光スキャナからの前記光を反射することによって、前記光スキャナの動作に伴って前記光が旋回される第1旋回点を形成する第1ミラーと、

前記第1ミラーによって反射された前記光を更に反射することによって、前記被検眼に出射される前記光が旋回される第2旋回点を形成する第2ミラーと、を有し、

前記第2旋回点における前記光の振り角に対し、前記第1ミラーに入射される光の振り角が小さいことを特徴とする眼底撮影装置。

## 【請求項 2】

前記第1ミラーは、前記走査光学系から前記第1ミラーへ入射するときの前記光の振り角に対して大きな振り角で、前記第1旋回点から前記第2ミラーへ入射する前記光を前記第1旋回点において旋回させる請求項1記載の眼底撮影装置。

## 【請求項 3】

前記第1ミラーは、前記第1旋回点を前記第1ミラーの焦点に形成し、

10

20

前記第2ミラーは、2つの焦点を持ち、一方の焦点に前記第1旋回点が位置されることによって、他方の焦点に前記第2旋回点が形成される請求項1又は2記載の眼底撮影装置。

【請求項4】

前記第1ミラーは、鏡面が二次曲面で形成された非球面鏡である請求項1から3のいずれかに記載の眼底撮影装置。

【請求項5】

前記第1ミラーは、凸面を反射面とし、

前記第2ミラーは、凹面を反射面とする請求項1から4のいずれかに記載の眼底撮影装置。

10

【請求項6】

前記眼底反射光が前記第1ミラーと前記第2ミラーとによって反射されることによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する請求項1から5のいずれかに記載の眼底撮影装置。

【請求項7】

前記第1ミラーは、前記第2ミラーによって生じる非対称な像面歪曲を補正する請求項1から6のいずれかに記載の眼底撮影装置。

【請求項8】

前記走査光学系は、

第1光源からの光を走査する第1光スキャナを有し、前記第1光源からの光による前記眼底の正面画像を得るためにSLO光学系と、

20

第2光源からの測定光を走査する第2光スキャナを有し、光干渉の原理を用いて前記被検眼の断層画像を得るためにOCT光学系と、

前記第1光スキャナと前記第1ミラーとの間であり、且つ、前記第2光スキャナと前記第1ミラーとの間ににおいて、前記SLO光学系の光路と前記OCT光学系の光路とを結合させる光路結合部材と、を有する請求項1から7のいずれかに記載の眼底撮影装置。

【請求項9】

前記SLO光学系、および前記OCT光学系は、物体側にテレセントリックであることを特徴とする請求項8記載の眼底撮影装置。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、眼底撮影装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来より、眼底撮影装置として、被検眼の眼底に対し、光スキャナを用いて光を走査することによって、眼底の画像を得る装置が知られている。例えば、走査型レーザー検眼鏡(SLO: Scanning laser ophthalmoscope)は、眼底上での走査の結果として、眼底の正面画像を得る。

【0003】

40

このような眼底撮影装置においては、眼底の広範囲を撮影することが試みられている(例えば、特許文献1参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開2014-138904号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、走査によって眼底の広範囲を撮影する装置の光学系には、改善の余地がある。

50

例えば、走査位置毎の収差の違いが画像に影響を与えやすい。また、特許文献1のように、走査範囲を広角化するための対物光学系が、レンズ系で構成されていると、レンズの面からの反射が、画像に影響してしまう場合が考えられる。

#### 【0006】

本開示は、従来技術の問題点の少なくとも一つに鑑み、眼底の広範囲を良好に撮影できる新たな光学系を備える眼底撮影装置を提供することを技術課題とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0007】

本開示の第1態様に係る眼底撮影装置は、光源からの光を被検眼の眼底上で走査するために前記光の進行方向を変える光スキャナを有する走査光学系と、前記光スキャナと前記被検眼との間に配置され、前記光スキャナからの前記光を前記眼底に導くための対物光学系と、を有し、前記光の眼底反射光に基づいて前記眼底の画像を形成する眼底撮影装置であって、前記対物光学系は、前記光スキャナからの前記光を反射することによって、前記光スキャナの動作に伴って前記光が旋回される第1旋回点を形成する第1ミラーと、前記第1ミラーによって反射された前記光を更に反射することによって、前記被検眼に射出される前記光が旋回される第2旋回点を形成する第2ミラーと、を有し、前記第2旋回点における前記光の振り角に対し、前記第1ミラーに入射される光の振り角が小さいことを特徴とする。

10

#### 【発明の効果】

#### 【0008】

20

本開示によれば、眼底の広範囲を良好に撮影できる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0009】

【図1】本実施形態の眼底撮影装置における光学系の概略構成を示す図である。

【図2】第1実施例に係る対物光学系を示した図である。

【図3】第1実施例に係る眼底撮影装置の電気的構成を示したブロック図である。

【図4】第2実施例に係る対物光学系を示した図である。

【図5】第3実施例に係る対物光学系を示した図である。

#### 【発明を実施するための形態】

#### 【0010】

30

以下、本開示における典型的な実施形態を、図面を参照しつつ説明する。

#### 【0011】

まず、図1および図2を参照して、本開示に係る眼底撮影装置（以下、「撮影装置」と省略する）の概要を説明する。撮影装置100は、被検眼Eの眼底上で光を走査することによって、眼底の画像を得る。眼底の画像は、正面画像であってもよいし、断層画像であってもよい。本開示の撮影装置100では、眼底における光の走査範囲が広範囲であってもよい。例えば、全角100°以上の範囲で光が走査され、その走査範囲内の画像が得られてもよい。

#### 【0012】

図1に示すように、撮影装置100は、走査光学系1と、対物光学系2と、を有する。また、撮影装置100は、受光光学系10a, 20aを有する。走査光学系1は、光源からの光を眼底Er上で走査するために、光の進行方向を変える光スキャナ15, 27を有する。また、対物光学系2は、走査光学系1（より詳細には、光スキャナ15, 27）と被検眼Eとの間に配置される。対物光学系2は、光スキャナ15, 27からの光を眼底Erに導くために利用される。対物光学系2によって眼底Erに導かれた光は、眼底Erで反射・散乱されることによって、瞳孔から射出される。瞳孔から射出された光は、受光光学系10a, 20aが有する検出器18, 31によって受光される。その結果として、検出器18, 31から出力される受光信号に基づいて、眼底の画像が形成される。なお、検出器18, 31は、例えば、走査光学系1に設けられていてよい。

40

#### 【0013】

50

走査光学系 1 は、 S L O 光学系 1 0 、 O C T 光学系 2 0 と、の 1 つを有してもよい。また、図 1 に示すように、両方を有してもよい。 S L O 光学系 1 0 は、光スキャナ 1 5 を有し、眼底 E r の正面画像を得るために利用される。 S L O 光学系 1 0 は、ライン状の光束を、光スキャナ 1 5 で少なくとも 1 方向に走査することによって眼底 E r を走査するライ 10 インスキャン S L O 光学系であってもよいし、点状の光束を、光スキャナ 1 5 で二次元的に走査するポイントスキャン S L O 光学系であってもよい。また、 O C T 光学系 2 0 は、光スキャナ 2 7 を有し、光スキャナ 2 7 を用いて測定光を眼底 E r 上で走査することによって、眼底 E r の断層画像を光干渉の技術を用いて非侵襲で得る。本実施形態において、光スキャナ 1 5 , 2 7 は、対物光学系 2 に関して被検眼 E の前眼部と共役な位置関係である。なお、本開示において、「共役」は、必ずしも完全な共役関係に限定されるものではない。本開示において、「共役」な関係は、完全な共役関係のほか、許容される精度の範囲で完全な共役関係からはずれた位置関係であってもよい。

#### 【 0 0 1 4 】

図 1 に示すように、走査光学系 1 に S L O 光学系 1 0 と、 O C T 光学系 2 0 との両方を含む構成においては、走査光学系 1 は、 S L O 光学系 1 0 の光路と、 O C T 光学系 2 0 の光路とを結合する光路結合部材 4 0 を有してもよい。 S L O 光学系 1 0 の光源 1 1 から出射される光の波長と、 O C T 光学系 2 0 の光源 2 1 から出射される光の波長とが、互いに異なり、かつ、光路結合部材 4 0 としては、波長選択的に光路を結合するダイクロイックミラーが用いられることが、好ましい。但し必ずしもこれに限られるものではなく、ハーフミラー等の他の光路結合部材であってもよい。図 1 において、光路結合部材 4 0 は、 S L O 光学系 1 0 と O C T 光学系 2 0 との光路を、それぞれの光学系が持つ光スキャナと、対物光学系 2 との間において結合する。このように、本実施形態では、 S L O 光学系 1 0 と O C T 光学系 2 0 とに個別に光スキャナが設けられている。その結果、例えば、正面画像の取得と並行して、任意の位置の断層画像を得ることが容易となる。

なお、受光光学系 1 0 a は、 S L O 光学系 1 0 から照射される光の眼底反射光が、検出器 1 8 によって受光される。また、受光光学系 2 0 a は、 O C T 光学系 2 0 によって照射される光（測定光）の眼底反射光が、参照光と合成されたうえで、検出器 3 1 に受光される。

#### 【 0 0 1 5 】

対物光学系 2 は、被検眼 E の前眼部（例えば、瞳孔領域）に、光スキャナ 1 5 , 2 7 の動作に伴って、光スキャナ 1 5 , 2 7 を介した光が旋回される旋回点（本実施形態における第 2 旋回点）を形成する。図 2 に示すように、対物光学系 2 は、レンズ要素を含まないミラー系であってもよい。この場合、眼底の画像に対する、対物光学系 2 によるノイズ（例えば、正面画像におけるフレア）等の影響を抑制できる。

#### 【 0 0 1 6 】

対物光学系 2 は、少なくとも、第 1 ミラー 5 0 と、第 2 ミラー 6 0 と、を含む。図 2 に示すように、本実施形態における対物光学系 2 は、第 1 ミラー 5 0 および第 2 ミラー 6 0 の他にもミラー等の光学部材を有していてもよい。

#### 【 0 0 1 7 】

本実施形態において、第 1 ミラー 5 0 は、走査光学系 1 と第 2 ミラー 6 0 との間に配置される。第 1 ミラー 5 0 は、光スキャナ 1 5 , 2 7 からの光が入射され、入射された光を第 2 ミラー 6 0 に中継する。

#### 【 0 0 1 8 】

本実施形態において、第 1 ミラー 5 0 は、光スキャナ 1 5 , 2 7 からの光を反射することによって、光スキャナ 1 5 , 2 7 の動作に伴って光（詳細には、第 1 ミラーによる反射光）が旋回される第 1 旋回点（図 2 において符号 r 1 で示す）を形成する。

#### 【 0 0 1 9 】

本実施形態において、第 1 ミラー 5 0 は、焦点を有するミラーであり、プラス又はマイナスのパワーを持っている。第 1 ミラー 5 0 は、第 1 旋回点を、第 1 ミラー 5 0 の焦点に形成する。

## 【0020】

このような第1ミラー50は、鏡面が2次曲面で形成される非球面鏡であることが好ましい。2次曲面は、2次曲線（円錐曲線ともいう）を対称軸周りに回転させた軌跡からなる。2次曲面からなる第1ミラー50としては、例えば、非球面鏡は、例えば、放物面鏡、双面鏡、楕円面鏡の少なくとも何れかであってもよい。但し、第1ミラー50は、鏡面が2次曲面の非球面鏡以外の形状であってもよい。例えば、球面ミラーであってもよいし、これ以外の形状も考えられる。また、本実施形態における第1ミラー50は、1枚のミラーであるが、複数枚のミラーの組合せで置き換えられてもよい。

## 【0021】

第2ミラー60は、正のパワーを持つ。第2ミラー60は、第1ミラー50によって反射された光を更に反射することによって、対物光学系2から被検眼Eに出射される光が旋回される第2旋回点を形成する。 10

## 【0022】

本実施形態において、第2ミラー60は、2つの焦点 $r_1, r_2$ を有する被検眼Eは、このうち一方の焦点 $r_2$ に配置される。より詳細には、前眼部（例えば、瞳孔位置）が、焦点 $r_2$ に位置するように配置される。また、第2ミラー60の他方の焦点 $r_1$ に、第1ミラー50によって形成される第1旋回点が一致するようにして、第1ミラー50と第2ミラー60とが配置されている。本実施形態では、その結果として、焦点 $r_2$ に、対物光学系2から眼底E $r$ に向かう光が旋回される第2旋回点 $r_2$ が形成される。

## 【0023】

図2に示す第2ミラー60は、回転楕円鏡（楕円面鏡）である。この場合、焦点 $r_1$ を経由して回転楕円鏡の鏡面で反射される光が、焦点 $r_2$ を必ず通過する。これにより、焦点 $r_2$ に配置される被検眼Eへ照射される光が、瞳孔においてケラレにくくなる。また、ケラレが抑制されることに伴って、広画角での眼底撮影が可能となる。 20

## 【0024】

なお、第2ミラー60として、回転楕円鏡以外の曲面鏡が適用されてもよい。曲面鏡は、例えば、回転楕円鏡と同様、二次曲面の鏡面を持つ非球面鏡であってもよい（具体例としては、放物面鏡、一対の双面鏡、等）。また、これ以外の形状を持つ非球面鏡であってもよい。また、本実施形態における第2ミラー60は、1枚のミラーであるが、複数枚のミラーの組合せで置き換えられてもよい。第2ミラー60の形状、大きさは、撮影する画角に応じて適宜設定される。例えば、本実施形態では、全角 $120^\circ$ 程度の撮影が可能な形状および大きさで形成されてもよい。 30

## 【0025】

このようなミラー構成により、本実施形態の対物光学系2は、第2旋回点 $r_2$ における振り角に対し、光スキャナ15, 22を経て第1ミラー50に入射される光の振り角を小さくする。

## 【0026】

ここで、本実施形態では、第1ミラー50と、第2ミラー60との一方または両方によって、撮影範囲が所期する画角となるように広角化される。図2の例のように、少なくとも第1ミラー50が、第1旋回点 $r_1$ から第2ミラー60へ向かう光の振り角を、光スキャナ15, 22を経て第1ミラー50に入射される光の振り角（より好ましくは、対物光学系2へ入射するときの光の振り角）に対して増大させ、これにより画角が広角化されてもよい。このような第2ミラー60の形状および配置は、例えば、光線追跡法によるシミュレーション等によって求めることができる。 40

## 【0027】

ところで、仮に、第1ミラー50が無く、第2ミラー60の一方の焦点 $r_1$ に、SLO光学系10とOCT光学系20とのうち一方の光スキャナ15, 27が配置され、その光スキャナから、第2ミラー60へ直接光を導く構成であったとした場合、次のような問題が生じる。すなわち、光スキャナと第2ミラー60との間のスペースを十分確保することは難しい。また、眼底上の広範囲において光を走査するためには、光スキャナの振り角を 50

大きくする必要があり、この場合、光スキャナと第2ミラー60との間のスペースに対し、光路結合部材40を適正に配置することがいっそう難しくなる。また、光路結合部材40には、入射角依存性を持つものがある。例えば、光路結合部材40の一例であるダイクロイックミラーは、設計値からの誤差が大きい入射角で入射される光に対しては、適正に透過又は反射することができない場合がある。このため、仮に、第2ミラー60と、焦点 $r_1$ の位置に配置される光スキャナとの間に、ダイクロイックミラーのような光路結合部材を配置できたとしても、この場合は、眼底画像の一部の画角（広角側）において画質が悪くなる。このため、SLO光学系とOCT光学系の一方または両方において、眼底の広範囲を撮影することが実質的に難しくなってしまう。

## 【0028】

10

これに対し、本実施形態では、各光スキャナ15, 27から第2ミラー60までの間に、第1ミラー50が挟まれている。そして、第1ミラー50が設けられた結果として、対物光学系2は、走査光学系1から対物光学系2へ入射するときの光の振り角に対して大きな振り角で、第1旋回点 $r_1$ において光を旋回する。換言すれば、第1旋回点 $r_1$ における振り角に対し、光スキャナ15, 22を経て第1ミラー50に入射される光の振り角を小さくできる。換言すれば、第2ミラー50よりも光源側の位置において、第2ミラー50へ入射する光の振り角よりも、光の振り角が小さな領域を形成できる。結果、第2ミラー50へ入射する光の振り角よりも、光の振り角が小さな領域に、光路結合部材40を配置するスペースを容易に確保できる。また、光結合部材40がこの領域に配置されることで、光路結合部材40の入射角依存性の問題を軽減できる。例えば、図1に示すように、SLO光学系10の光スキャナ15と第1ミラー50との間であり、且つ、OCT光学系20の光スキャナ27と第1ミラー50との間に光路結合部材40を配置することで、SLO光学系10の光路とOCT光学系20の光路とを、良好に結合できる。その結果として、正面画像と、断層画像とのそれぞれを、良好に取得することが可能となる。

20

## 【0029】

なお、SLO光学系10と、OCT光学系20とのそれぞれは、図1に示すように、物体側テレセントリックであってもよい。この場合、光路結合部材40への入射角度が、走査位置によらず一定であるので、光路結合による光量損失を良好に抑制でき、良好な眼底の画像を得ることができる。

30

## 【0030】

また、図2に示すように、第2ミラー60として、回転橜円鏡が用いられる場合は、第2ミラー60によって、非対称な像面歪曲（例えば、台形歪み）が生じてしまう。なお、第2ミラー60に、回転橜円鏡以外の形状が採用される場合にも、このような像面歪曲が生じる場合があると考えられる。

## 【0031】

40

第2ミラー60によって生じる像面歪曲は、第1ミラー50によって補正されてもよい。例えば、第1ミラー50が第2ミラー60に対して傾斜して配置されることによって、上記の像面歪曲が補正されてもよい。ここでいう傾斜とは、例えば、第1ミラー50と、第2ミラー60との間における光路の中心を通過する光線（主に、被検眼Eの眼軸を通過する光線）に対し、第1ミラー50が、その軸（例えば、非球面鏡の鏡面を形成する2次曲線における対称軸）を傾斜させて配置されることをいう。傾斜量は、少なくとも像面歪曲の非対称成分が打ち消される程度であることが望ましい。つまり、残存する像面歪曲が軸対称となるような傾斜量が、採用されてもよい。

## 【0032】

また、図2の例では、第2ミラー60に回転橜円鏡を用いる結果として、眼底反射光による中間像Ic2等の中間像の像面が、光学系の光軸に対して斜めに傾いてしまうことが考えられる。なお、第2ミラー60に、回転橜円鏡以外の形状が採用される場合にも、このような像面の傾きが生じる場合があると考えられる。

## 【0033】

これに対し、本実施形態の撮影装置100には、眼底反射光が第1ミラー50と第2ミ

50

ラー 6 0 とによって反射されることによって生じる像面の傾きを補正する光学部材が設けられていてもよい。

【 0 0 3 4 】

例えば、像面の傾きを補正する光学部材は、光源 1 1 , 2 1 からの光が、被検眼 E に導かれるまでの投光光路と、眼底反射光が、検出器 1 8 , 3 1 に導かれるまでの受光光路と、の共通光路に配置されていてもよい。また、投光光路および受光光路のそれぞれにおける独立光路に、それぞれ配置されてもよい。

【 0 0 3 5 】

共通光路に配置される場合の具体例として、眼底反射光における像面の傾きを補正する補正ミラー系 7 1 , 7 2 が、光学部材として、対物光学系 2 に設けられていてもよい。補正ミラー系 7 1 , 7 2 は、第 1 ミラー 5 0 および第 2 ミラー 6 0 による像面の傾きを相殺するように、像面を更に傾ける。結果、図 2 に示すように、補正ミラー系 7 1 , 7 2 を経て形成される眼底反射光の中間像（例えば、図 2 の中間像 I c 1 ）において、像面の傾きが軽減される。

10

【 0 0 3 6 】

別の具体例として、共通光路中に、光軸に対して傾けられたレンズが配置されることによって、像面の傾きが補正されてもよい。例えば、図 1 の例では、スキャンレンズ 1 6 , 2 9 が傾斜配置されてもよい。

【 0 0 3 7 】

また、光学部材が、投光光路および受光光路のそれぞれの独立光路に配置される場合において、少なくとも S L O 光学系 1 0 の検出器 1 8 が、光学部材の 1 つとして利用されてもよい。例えば、S L O 光学系 1 0 がラインスキャン S L O 光学系である場合は、検出器 1 8 としてラインセンサ又はエリアセンサが用いられる。この場合は、検出器 1 8 を受光光学系 1 0 a の光軸に対して傾けることによって、像面の傾きを補正できる。検出器 1 8 の傾斜量は、眼底 E r および対物光学系 2 と、シャインブルーフの関係となるように調整されることが望ましい。また、併せて、S L O 光学系 1 0 における投光光学系 1 0 a の独立光路に、光軸に対して傾斜配置されるレンズ等の光学部材を有してもよい。

20

【 0 0 3 8 】

なお、S L O 光学系 1 0 が、ポイントスキャン S L O 光学系である場合には、検出器から被検眼 E までの受光光路上に、検出器とは別体に光学部材（例えば、傾斜配置されたレンズ、補正ミラー系等）が設けられることが望ましい。これにより、像面の傾きを抑制することで、光スキャナ 1 5 による走査位置の変化に応じて眼底 E r の共焦点位置が動いてしまうことが抑制される。結果、光学部材と検出器 1 8 との間に、静止した眼底共役点を形成できる。このため、有害光を除去するためのアパー チャを、静止した共焦点位置に配置することができ、良好な正面画像を得ることができる。

30

【 0 0 3 9 】

＜実施例＞

図 1 を参照して、第 1 実施例における撮影装置 1 0 0 を説明する。第 1 実施例における撮影装置 1 0 0 は、図 1 に示す走査光学系 1 と、図 2 に示す対物光学系 2 と、を有する。走査光学系 1 は、S L O 光学系 1 0 と、O C T 光学系 2 0 と、ダイクロイックミラー 4 0（第 1 実施例における光路結合部材）と、を含む。

40

【 0 0 4 0 】

＜S L O 光学系＞

まず、S L O 光学系 1 0 について説明する。S L O 光学系 1 0 は、主に、光源から発せられた光（照明光）を眼底上で二次元的に走査する光スキャナ 1 5 と、検出器 1 8 を含み、眼底 E r の共焦点を通過する（照明光の）眼底反射光を検出器に受光させる受光光学系 1 0 a と、を持つ。また、第 1 実施例において、S L O 光学系 1 0 は、ラインスキャンタイプであり、検出器 1 8 にはラインセンサが利用される。この場合、S L O 光学系 1 0 は、光スキャナ 1 5 と検出器 1 8 と、の他に、光源 1 1 と、コリメートレンズ 1 2 と、円柱レンズ 1 3 と、穴開きミラー 1 4 と、スキャンレンズ 1 6 と、集光レンズ 1 7 と、を有し

50

てもよい。このうち、光スキャナ15と、スキャンレンズ16と、集光レンズ17と、ラインセンサ(検出器)18とは、第1実施例におけるSLO光学系10の受光光学系10aを構成する。

【0041】

第1実施例において、光源11は、例えば、赤外域の波長の光(例えば、レーザー光)を発する。光源11としては、例えば、LED光源、およびSLD光源、等が用いられてもよい。光源11からの光は、コリメートレンズ12でコリメートされた後、円柱レンズ13によって集光される。その後、穴開きミラー14の開口を通過して光スキャナ15に導かれる。なお、光源11から出射される光は、必ずしも赤外光に限られるものではない。例えば、白色光であってもよいし、2色以上の光(例えば、赤、青、緑)などの光が合成された、合成光であってもよい。

【0042】

第1実施例において、光スキャナ15には、ガルバノミラーが用いられてもよい。但し、必ずしもこれに限られるものではなく、反射ミラーを動作させる他の光スキャナ(例えば、レゾナントミラー、ポリゴンミラー等)、および、音響光学素子等のいずれかに置き換えるてもよい。光スキャナ15は、被検眼Eの瞳孔と共に位置に配置される。

【0043】

光スキャナ15を経た光は、スキャンレンズ16によって、走査光学系1の光軸L1に対して、平行な光線(つまり、テレセントリックな光線)にされる。つまり、第1実施例において、スキャンレンズ16は、その焦点が光スキャナ15(光スキャナ15の旋回点r3)と一致するようにして配置されている。これにより、第1実施例におけるSLO光学系10は、物体側テレセントリックとなる。スキャンレンズ16を通過した光は、ダイクロイックミラー40を更に通過して、対物光学系2へ入射される。なお、第1実施例においてダイクロイックミラー40は、SLO光学系10からの光を透過し、OCT光学系20からの光を反射する分光特性を持つ。なお、物体側テレセントリックは、光源11、22側から見て、被検眼E側にテレセントリックな状態を意味する。

【0044】

SLO光学系10からの光は、対物光学系2によって眼底Erに導かれることによって、眼底Erで散乱・反射される。その結果として、眼底反射光として、瞳孔から出射され、投光時と逆の光路を辿る。そして、眼底反射光は、対物光学系2から走査光学系1へ向けて出射されることによって、ダイクロイックミラー40を通過して、SLO光学系10の受光光学系10aへ入射する。受光光学系10aにおいて、眼底反射光は、スキャンレンズ16を通過し、光スキャナ15で反射されて、穴開きミラー14へ向かう。その後、穴開きミラー14で反射された眼底反射光が、集光レンズ17で集光されて、検出器18に受光される。本実施形態では、光スキャナ15による1フレーム分の光走査に基づいて検出器18から出力される信号に基づいて、眼底の正面画像が形成される。

【0045】

< OCT光学系 >

次に、OCT光学系20について説明する。OCT光学系20は、例えば、光源21と、光分割部(図1の例では、カップラ)23と、光スキャナ27と、検出器31と、を有してもよい。OCT光学系20は、更に、スキャンレンズ29と、参照光学系25と、を有してもよい。

【0046】

このようなOCT光学系20としては、SS-OCT(Swept Source-OCT)方式、SD-OCT(Spectral domain-OCT)方式等のフーリエドメイン方式が用いられてもよい。ここでは、一例として、SS-OCT(Swept Source-OCT)方式が用いられるものとして説明する。

【0047】

光源21は、出射波長を時間的に高速で変化させる波長可変光源(波長走査型光源)である。光源21は、出射光の波長を変化させる。検出器31は、例えば、受光素子からな

10

20

30

40

50

る平衡検出器であってもよい。

【0048】

OCT光学系20は、光源21から出射された光をカップラ(スプリッタ)23によって測定光と参照光に分割する。

【0049】

OCT光学系20は、測定光を、光スキャナ27を介して、対物光学系2へ導く。また、参照光を参照光学系25に導く。光スキャナ27は、眼底Er上でXY方向(横断方向)に測定光を走査させる。光スキャナ27は、例えば、2つのガルバノミラーであり、その反射角度が図示無き駆動機構によって任意に調整されてもよい。また、ガルバノミラーに代えて、反射ミラーを動作させる他の光スキャナ(例えば、レゾナントミラー、ポリゴンミラー等)、および、音響光学素子等が用いられてもよい。 10

【0050】

光スキャナ27を経た光は、スキャンレンズ29によって、走査光学系1の光軸に対し、平行な光線(つまり、テレセントリックな光線)にされる。つまり、第1実施例において、スキャンレンズ29は、その焦点が光スキャナ27(例えば、X走査用の光スキャナとY走査用の光スキャナとの中間点r4)と一致するようにして配置されている。これにより、本実施形態におけるOCT光学系20は、物体側テレセントリックとなる。スキャンレンズ29を通過した光は、ダイクロイックミラー40によって反射されることにより、対物光学系2へ入射される。 20

【0051】

SLO光学系10からの光と同様、OCT光学系20からの光は、対物光学系2によって眼底Erに導かれることによって、眼底で散乱・反射される。その結果として、測定光の眼底反射光が、対物光学系2を投光時とは逆に逆って、走査光学系1へ向けて出射される。その結果、測定光の眼底反射光は、ダイクロイックミラー40で反射されて、OCT光学系20の検出光学系20a(OCT光学系20の受光光学系)へ入射する。即ち、眼底反射光は、スキャンレンズ29を通過し、光スキャナ27を経て、カップラ(スプリッタ)23へ入射される。その後、測定光の反射光は、光結合部(カップラ)23によって参照光と合波されて干渉する。

【0052】

参照光学系25は、眼底Erでの測定光の反射によって取得される反射光と合成される参照光を生成する。参照光学系25は、例えば、マイケルソンタイプであってもよいし、マッハツエンダタイプであっても良い。図1において、参照光学系25は、例えば、反射光学系(例えば、参照ミラー)によって形成され、カップラ23からの光を反射光学系により反射することにより、参照光を検出器31へ導く。他の例としては、参照光学系25は、透過光学系(例えば、光ファイバー)によって形成され、カップラ23からの光を戻さず透過させることにより検出光学系31へと導いてもよい。 30

【0053】

撮影装置100は、測定光と参照光との光路長差を調整するためにOCT光学系20に配置された光学部材の少なくとも一部を光軸方向に移動させる。例えば、参照光学系25は、参照光路中の光学部材(例えば、図示無き参照ミラー)を移動させることにより、測定光と参照光との光路長差を調整する構成を有する。例えば、駆動機構25aの駆動によって参照ミラーが光軸方向に移動される。光路長差を変更するための構成は、測定光の光路中に配置されてもよい。つまり、測定光の光路長を変更することによって、測定光と参照光との光路長差が調整されてもよい。 40

【0054】

測定光と参照光とが合成された干渉信号光は、検出器31によって受光される。検出器31は、干渉信号光を検出する。ここで、光源21により出射波長が変化されると、これに対応する干渉信号光が検出器31によって受光され、結果的に、スペクトル干渉信号光として検出器31に受光される。検出器31から出力されたスペクトル干渉信号に基づいて、眼底上的一点における深さプロファイル(ASキャン、または、OCTデータともい 50

う)が形成される。深さプロファイルは、眼底の深さ方向に関する測定光の反射強度分布である。この深さプロファイル(OCTデータ)が、並べられることによって、二次元OCTデータ(例えば、眼底の断層画像、およびOCTアンジオグラフィー等)が形成される。

#### 【0055】

<対物光学系>

次に、図2を参照して、第1実施形態における対物光学系2を説明する。図2の例では、第2ミラー60は、1枚の回転橜円鏡である。第2ミラー60は、2つの焦点 $r_1$ ,  $r_2$ を有する。被検眼Eは、このうち一方の焦点 $r_2$ に配置される。

#### 【0056】

第1実施例において、第1ミラー50は、放物面鏡である。第1実施例において、放物面鏡である第1ミラー50の焦点と、回転橜円鏡である第2ミラー60の2つの焦点のうち1つ(焦点 $r_1$ )と、が一致するように、第1ミラー50および第2ミラー60は配置される。また、第2ミラー60の2つの焦点のうち残り1つ(焦点 $r_2$ )が被検眼Eの前眼部に配置される。なお、この場合、第1ミラー50の凸面、および、第2ミラー60の凹面が、それぞれの反射面として用いられる。ここで、放物面鏡は、対称軸Z2に対して平行に入射される光を、みかけ上、焦点 $r_1$ から発せられる光に変換する。また、第1ミラー50は、更に、一方の焦点 $r_1$ から発せられた光を、もう1つの焦点 $r_2$ に集光させる。このため、第1実施例では、物体側テレセントリックなSLO光学系10, OCT光学系20からの光が、第1ミラー50の対称軸に対する平行光として第1ミラー50へ入射されることで、SLO光学系10からの光、および、OCT光学系20からの光を、被検眼Eの前眼部に位置する焦点 $r_2$ を旋回点として旋回させることができる。このように、対物光学系2における第1ミラー50と第2対物ミラー60とが上記の形状、配置で設けられることによって、光スキャナ15, 22を経て第1ミラー50へ入射される光の振り角を抑制しつつ、眼底の広範囲を走査することが可能となる。

#### 【0057】

なお、第1ミラー50が放物面鏡である場合について説明したが、第1ミラー50は、撮影画角を広角化するための非球面鏡についての具体例の一つであって、放物面鏡以外の非球面鏡が第1ミラー50として適用されてもよい。

#### 【0058】

また、第1実施例では、第1ミラー50と、第2ミラー60との他に、補正ミラー系71, 72が対物光学系2に設けられている。第1実施例において、補正ミラー系71, 72は、放物面鏡71と平面鏡72とによって構成される。第1ミラー50である放物面鏡と第2ミラー60である回転橜円鏡とによって眼底反射光が反射されることによって生じる像面の傾きが、補正ミラー系71, 72によって補正される。また、第1実施例では、物体側テレセントリックなSLO光学系10, OCT光学系20からの光を、対称軸Z2に対して平行な光として、第1ミラー50へ入射させる。

#### 【0059】

第1実施例において、放物面鏡71は、対称軸 $z_1$ を挟んで対称に形成された凹面を持つ。走査光学系1からの光は、対称軸 $z_1$ に対して平行に入射される。また、平面鏡72は、放物面鏡71の焦点位置 $r_5$ において、放物面鏡71と正対して配置されている。このような補正ミラー系71, 72に対し、走査光学系1からの光が入射すると、放物面鏡71 平面鏡72(つまり、放物面鏡の焦点 $r_5$ ) 放物面鏡71の順で反射され、対称軸 $z_1$ と平行に出射される。このため、補正ミラー系71, 72の両側で、光束はテレセントリックになる。また、補正ミラー系71, 72での反射によって、像面が傾斜される(図2の中間像Ic2を参照)。この傾斜は、第1ミラー50と第2ミラー60とによって生じる像面の傾斜を、打ち消す方向に行われる。なお、図2に示すように、第1ミラー50と第2ミラー60とによって生じる傾斜が、非線形なものである場合、補正ミラー系71, 72は、少なくともこの傾斜の非線形成分を打ち消すことが望ましい。

#### 【0060】

10

20

30

40

50

第1実施例における第1ミラー50は、放物面鏡71、および第2ミラー60に対して凸面を向ける凸面鏡である。つまり、第1ミラー50は、マイナスのパワーを持つ。第1ミラー50は、放物面鏡71に対して偏心して（軸外しで）配置されている。つまり、第1ミラー50の鏡面の対称軸（つまり、放物面の対象軸）である対称軸z2は、放物面鏡71の対称軸z1に対し、間隔を開けて平行となっている。このため、第1ミラー50には、対称軸z2と平行な光線が、放物面鏡71から照射される。また、第1ミラー50は、回転楕円鏡である第2ミラー60が有する2つの焦点r1, r2うち、一方の焦点r1に、第1ミラー50の焦点を一致させて配置されている。このため、放物面鏡71から第1ミラー50のある位置に光が照射された場合、その照射位置と、焦点r1とを結ぶ直線上に光は反射される。つまり、第1ミラー50から第2ミラー60へ向かう光は、光スキャナ15（或いは、光スキャナ27）の駆動に伴って、第2ミラーである回転楕円鏡の焦点r1を中心にして旋回する。換言すれば、第1ミラー50によって、光スキャナ15（或いは、光スキャナ27）を経て第2ミラー60に向かう光の旋回点が、焦点r1に形成される。第1実施例では、第1ミラー50の鏡面で光が反射されることによって、第1旋回点r1から第2ミラーへ向かう光の振り角が、走査光学系1から第1ミラー50に入射する光の振り角に対し、増大される。このため、第1実施例では、第1ミラー50に対して入射する光の振り角が、第2ミラー60へ入射する光の振り角よりも抑制される。一例として、図1に示すように、テレセントリックな光を入射することもできる。この場合の振り角 = 0として考えるものとする。

## 【0061】

また、第2ミラー60である回転楕円鏡の一般的な特性により、焦点r1を通過し、且つ、回転楕円鏡の鏡面で反射された光は、他方の焦点r2に導かれる。このため、他方の焦点r2（つまり、被検眼Eの前眼部の位置）に、第2ミラー60で反射された光の旋回点（第2旋回点）が形成される。この旋回点（焦点r2）における光の振り角は、焦点r1での振り角と、第2ミラー60における鏡面の形状と、によって定められる。第2ミラー60は、焦点r2での振り角を、焦点r1での振り角に対して大きくさせる形状であつてもよい。但し、必ずしもこれに限られるものではない。

## 【0062】

このように、第1実施例では、走査光学系1から対物光学系2（より詳細には、放物面鏡71）に対して、テレセントリック（振り角 = 0）で光を入射させて、眼底E rの広範囲を撮影することが可能となる。第1実施例では、SLO光学系10とOCT光学系20との光路を結合するための光結合部材40（ダイクロイックミラー40）が、SLO光学系10とOCT光学系20とのそれぞれがテレセントリックとなっている箇所に配置されるので、広画角の正面画像と断層画像とを、良好に得ることができる。

## 【0063】

ここで、第2ミラー60は、回転楕円鏡であるので、眼底反射光に非対称な像面歪曲（例えば、台形歪み）を生じさせてしまう。これに対し、本実施例では、第1ミラー50を第2ミラー60に対して傾けて配置することによって、像面歪曲が抑制される。即ち、第1ミラー50と第2ミラー60との間における光路の中心を通過する光線に対して傾斜して第1ミラー50が配置される。第1ミラー50の傾斜量に応じて、像面歪曲の補正量が変化する。第1ミラー50の傾斜量は、例えば、残存する像面歪曲が軸対称となるように設定されてもよい。

## 【0064】

## &lt;制御系&gt;

次に、図3を参照して、撮影装置100の制御系について説明する。制御部70は、撮影装置100の装置全体の制御を行うプロセッサ（例えば、CPU）である。

## 【0065】

第1実施例において、制御部70には、メモリ72、モニタ75、等が電気的に接続される。また、制御部70には、光源11, 21, 光スキャナ15, 27, 検出器18, 31, 駆動機構25a等が電気的に接続される。

10

20

30

40

50

## 【0066】

メモリ72は、各種の制御プログラムおよび固定データを格納する。また、メモリ72には、撮影装置100によって撮影された画像、一時データ等が記憶されてもよい。

## 【0067】

本実施形態では、制御部70が画像処理部を兼用する。例えば、検出器18および検出器31からの受光信号は、それぞれ制御部70に入力される。制御部70は、検出器18からの信号に基づいて眼底E<sub>r</sub>の正面画像を形成する。また、制御部70は、検出器31からの信号に基づいて、眼底E<sub>r</sub>の断層画像を形成する。このとき、制御部70は、光源11からの光と光源21からの光とを、光スキャナ15と光スキャナ27とを同時に、且つ、独立して駆動することにより、正面画像と、断層画像とを、並行して取得してもよい。同時に得た正面画像と断層画像とを、モニタ75に対して、同時に動画として表示させてもよい。第1実施例では、SLO光学系10の光スキャナ15と、OCT光学系20の光スキャナ27とが独立に設けられているので、制御部70は、正面画像と、断層画像とを、互いに異なるフレームレートで取得してもよい。

10

## 【0068】

## &lt;第2実施例&gt;

次に、図4を参照して、第2実施例を説明する。第2実施例において、第1実施例と同様の構成については、第1実施例と同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。

## 【0069】

第2実施例は、走査光学系1および対物光学系2の一部が、第1実施例に対して相違している。例えば、第1実施例において、SLO光学系10およびOCT光学系20のそれぞれは、物体側にテレセントリックであったが、第2実施例では、走査光学系1（より詳細には、SLO光学系10およびOCT光学系20）から、対物光学系2へ入射する光が、対物光学系2から有限遠の旋回点を中心として、旋回されている。第2実施例では、説明の便宜上、対物光学系2へ入射するときのSLO光学系10からの光は、旋回点r3を中心として旋回されており、対物光学系2へ入射するときのOCT光学系20からの光は、旋回点r4を中心として旋回されているものとする。

20

## 【0070】

第2実施例の対物光学系2は、第1ミラー50と光スキャナ15, 27との間に、放物面鏡171を有する。放物面鏡171は、その焦点が、旋回点r3, r4と一致するように配置された凹面鏡である。このため、放物面鏡171の物体側では、光束はテレセントリックになる。さらに、第2実施例では、放物面鏡171における鏡面の対象軸（つまり、放物面の対称軸、図示せず）が、第1ミラー50における鏡面の対称軸z2と平行になるように配置されている。このため、第1実施例と同様、第1ミラー50には、対称軸z2と平行な光線が、光スキャナ15, 27側から（つまり、放物面鏡171）から照射される。結果、第1ミラー50の焦点と第2ミラー60との焦点とが重なる位置である第1旋回点r1を中心として、第1ミラー50から第2ミラー60へ向かう光が旋回される。そして、更に、第2ミラー60で光が反射されることによって、その光が、回転橈円鏡のもう1つの焦点r2を旋回点として旋回される。このようにして、第2実施例においても、走査光学系1から対物光学系2（より詳細には、放物面鏡171）に対して入射する光の振り角を抑制しつつ、眼底E<sub>r</sub>の広範囲において、光を良好に走査することが可能となる。結果、光結合部材40（ダイクロイックミラー40）の入射角依存性によって、眼底の画像の画質が部分的に悪くなってしまうことが抑制される。

30

40

## 【0071】

所期する画角で眼底画像を撮影する場合に、放物面鏡171における焦点距離が長いほど、光スキャナ15, 27における光の振り角を抑制できる。このため、許容される装置サイズとなる範囲で、より長い焦点距離を持つ放物面鏡171が適用されることが好ましい。これにより、光路結合部材40の入射角依存性の問題をより効果的に軽減できると考えられる。

## 【0072】

50

なお、本件の発明者によれば、第1実施例の光学系と、第2実施例の光学系とを、それぞれある条件で設計した場合において、第2実施例のほうが、より高い結像性能を奏することが確認された。

【0073】

ところで、第1実施例の補正光学系71, 72の代わりに設けられている放物面鏡171は、像面の傾斜を補正しない。これに対し、第2実施例では、少なくともSLO光学系10における像面の傾斜を抑制するために、少なくとも、受光光学系10aの光軸に対して傾斜配置される検出器18が設けられていてもよい。なお、併せて、SLO光学系10におけるレンズ12又はレンズ13のいずれかが光軸に対して傾斜配置されていてもよい。このような第2実施例において、検出器18の傾斜量は、眼底Erおよび対物光学系2と、シャインブルーフの関係となるように調整される。結果、像面の傾きによって(つまり、フォーカスが、走査位置によって異なることによって)画質が悪くなってしまうことが抑制される。

【0074】

<第3実施例>

次に、図5を参照して、第3実施例を説明する。第3実施例において、第1実施例と同様の構成については、第1実施例と同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。第3実施例は、主に、第1ミラー50の形状が、第1実施例および第2実施例と相違する。また、第3実施例では、第1ミラー50と、走査光学系1との間に、ミラー系を含まない。第3実施例において、走査光学系1および対物光学系2の一部が、第1実施例に対して相違している。例えば、第1実施例において、SLO光学系10およびOCT光学系20のそれぞれは、物体側にテレセントリックであったが、第3実施例では、第2実施例と同様、走査光学系1(より詳細には、SLO光学系10およびOCT光学系20)から対物光学系2へ入射する光が、対物光学系2から有限遠の旋回点を中心として、旋回される。

【0075】

第3実施例において、第1ミラー50は、1つの双曲面鏡(1対の双曲面の一方)である。双曲面鏡は、第3実施例において、広角化に寄与する非球面鏡である。第2ミラー60は、第1実施例と同様に、回転楕円鏡であってもよい。第1ミラー50である双曲面鏡は、虚像側の焦点(凸面側にある焦点)が旋回点r3, r4と一致するように配置される。また、第1ミラー50は、実像側の焦点(凹面側にある焦点)が、第2ミラー60の一方の焦点と一致するように配置される。つまり、第1ミラー50には、虚像側(第1ミラー50と対になる双曲面側)の焦点から出射される光が照射される。その結果、双曲面鏡の一般的な特性により、第1ミラー50で反射された反射光は、光スキャナ15(或いは、光スキャナ27)の駆動に伴って、第1ミラー50の実像側の焦点r1を中心として旋回する。ここで、焦点r1は、回転楕円鏡である第2ミラー60の焦点でもあるので、第1ミラー50の配置によって、第1ミラー50で反射される光の旋回点が、回転楕円鏡の焦点r1に形成される。第3実施例では、第1ミラー50の鏡面で光が反射されることによって、第1旋回点r1から第2ミラー60へ向かう光の振り角は、走査光学系1から第1ミラー50に入射する光の振り角に対し、増大される。そして、第2ミラー60で反射された光が、第2ミラー60が持つもう1つの焦点r2を旋回点として旋回される。このようにして、第3実施例においても、走査光学系1から対物光学系2(より詳細には、第1ミラー50)に対して入射する光の振り角を抑制しつつ、眼底Erの広範囲において、光を良好に走査することが可能となる。

【0076】

なお、第3実施例における第1ミラー50は、双曲面鏡(離心率>1)であり、双曲面の離心率が1に近づくほど、つまり、ミラー形状が第1実施例で示した放物面形状に近づく。このため、双曲面の離心率が1に近づくほど、虚像側の焦点(凸面側にある焦点)がミラー面から遠くなり、無限大に近づく。このため、所期する画角で眼底画像を撮影する場合に、第1ミラー50における離心率が1に近いほど、光スキャナ15, 27における光の振り角を抑制できる。このため、許容される装置サイズとなる範囲で、より1に近い

10

20

30

40

50

離心率を持つ双曲面鏡が、第1ミラー50に適用されることが好ましい。これにより、光路結合部材40の入射角依存性の問題をより効果的に軽減できると考えられる。

【0077】

なお、図5に示すように、第1ミラー50は、第2ミラー60に対して傾斜して配置されてもよい。この場合に生じる像面の傾きを補正するために、例えば、SLO光学系10の検出器18等が、光軸に対して傾けて配置されてもよい。

【0078】

＜断層画像取得時における装置の動作＞

上記各実施例の対物光学系2は、被検眼Eと光スキャナ27との間に配置されるミラー系（例えば、第1ミラー50および第2ミラー60等）を介して、被検眼Eの前眼部（例えば、瞳孔位置）に光スキャナ27の動作に伴って旋回される旋回点（上記各実施例においては、旋回点r2）を形成する対物ミラー系である。対物光学系2は、例えば、上記各実施例では、被検眼Eの直前の第2ミラー60は、回転橈円鏡であり、この回転橈円鏡が持つ2つの焦点r1, r2のうち1つに、旋回点r2は形成される。回転橈円鏡における2つの焦点のうち、一方から鏡面に向けて入射して、他方の焦点に導かれる光は、2つの焦点の間における光路長が常に一定となる。しかし、上記各実施例では、光スキャナ27と第2ミラー60との間に、第1ミラー50等のミラーが配置されていることによって、光スキャナ27から第2旋回点r2までの測定光の距離が、光スキャナ27の走査位置に応じて異なりうる。

【0079】

また、上記各実施例において、第2旋回点r2（瞳孔位置）から眼底Eまでの測定光の光路長も走査位置毎に異なっている。つまり、眼底の湾曲によって、第2旋回点r2から眼底Eまでの測定光の距離が、光スキャナ27の走査位置に応じて異なりうる。

【0080】

このように、光スキャナ27から被検眼Eまでの測定光の距離が、光スキャナ27の各走査位置で異なることが考えられる。つまり、前記光スキャナ27の各走査位置での光スキャナ27から被検眼Eまでの測定光の距離による測定光と参照光との光路長差に変化が生じることが考えられる。

【0081】

この状態で、検出器31からの信号に基づいて深さプロファイル（OCTデータ）を得る場合、被検眼Eにおいて深さプロファイル（OCTデータ）が取得される領域の深さ位置が、光スキャナ27の走査位置毎に異なってしまうことが考えられる。また、走査位置によっては、光路長差が大きいことによって、検出器31の感度が高い範囲と、測定光と参照光との干渉が生じる範囲とが、比較的大きくずれてしまう場合が考えられる。

【0082】

これに対し、制御部70は、光スキャナ27の各走査位置での光スキャナ27から被検眼Eまでの測定光の距離による測定光と参照光との光路長差の変化を補正する。

【0083】

ここで、測定光と参照光との光路長差の変化は、データ上（OCTデータの処理によって）で補正されてもよい。例えば、制御部30は、検出器31からの信号に基づいて制御部30がOCTデータを取得する際に、そのOCTデータの深さ方向の位置情報を補正してもよい。

【0084】

また、制御部30は、複数のOCTデータを並べて二次元OCTデータを形成する際に、各走査位置のOCTデータ間における相対的な深さ位置を補正してもよい。

【0085】

このような処理が行われた結果として、OCTデータ（或いは、二次元OCTデータ）を良好に得ることができる。

【0086】

10

20

30

40

50

また、参照光と測定光との光路長差の変化は、光学的に補正されてもよい。例えば、補正は、光スキャナ 27 の走査位置に応じて光路長調整機構 25a (駆動機構) を駆動制御することによって行われてもよい。駆動機構 25a は、前述したように、参照光の光路 (又は、測定光の光路) 上に配置された光学部材 (例えば、ミラー) を変位させることによって、測定光と参照光との光路長差を調整してもよい。例えば、本実施例では、光スキャナ 27 の動作に伴う測定光の光路長の変化に合わせて、参照光の光路長が駆動機構 25a によって変化される。その結果、検出器 31 の感度が高い範囲において測定光と参照光との干渉に基づく信号が検出されやすくなり、OCT データ (或いは、二次元 OCT データ) を良好に得ることができる。なお、この場合、走査位置によらずに、測定光と参照光との干渉に基づく信号が検出器 31 の感度が比較的高い範囲において検出されるように、光路長差が変化する範囲を抑制できればよく、必ずしも、測定光と参照光との光路長差が各走査位置において一定 (例えば、ゼロ) となるように駆動機構 25a が駆動制御される必要はない。

#### 【0087】

ここで、制御部 70 は、少なくとも光スキャナ 27 から第 2 旋回点  $r_2$  までの測定光の距離 (光路長) の変化を考慮して、測定光と参照光との光路長差の変化を補正する。また、制御部 70 は、眼底の湾曲による各走査位置での測定光の光路長の変化 (つまり、第 2 旋回点  $r_2$  から眼底  $E_r$  までの測定光の光路長の変化) を更に考慮して、補正を行ってもよい。ここで、光スキャナ 27 から第 2 旋回点  $r_2$  までの測定光の光路長と、光スキャナ 27 の各走査位置と、の対応関係は、光学系の設計によって定まっている。また、第 2 旋回点から眼底  $E_r$  までの測定光の光路長と、光スキャナ 27 の各走査位置と、の対応関係も光学系の設計 (主に第 2 旋回点での振り角) によっておおよそ定まる。

#### 【0088】

そこで、例えば、光路長差の変化を補正するための補正量 (例えば、光路長の変化量、或いは、OCT データにおける深さ方向の位置情報の補正量) が光スキャナ 27 の各走査位置と対応づけられた補正テーブルが、メモリ 72 に予め用意されていてもよい。そして、制御部 70 は、この補正テーブルを用いて、光路長差の変化の補正処理を行ってもよい。このようなテーブルにおける補正量は、少なくとも光スキャナ 27 から第 2 旋回点  $r_2$  までの測定光の光路長の変化が考慮された値である。さらに、第 2 旋回点  $r_2$  から眼底  $E_r$  までの光路長の変化が考慮された値であってもよい。このような光路長差と補正量との対応関係 (換言すれば、走査位置と補正量との対応関係) は、例えば、シミュレーションおよびキャリブレーション等によって予め求められてもよい。

#### 【0089】

なお、上記実施例では、光スキャナ 27 は、2 つの光スキャナを含んでいる。つまり、測定光の主走査を行う第 1 光スキャナ (例えば、X ガルバノスキャナ) と、主走査の方向とは交差する方向に測定光の副走査を行う第 2 光スキャナ (例えば、) と、が含まれている。主走査が、各図の紙面奥行き方向に行われ、副走査が、紙面奥行き方向に対し、交差する方向に行われる場合、副走査の位置のみに応じて、測定光における光路長の変化 (より詳細には、光スキャナ 27 から第 2 旋回点  $r_2$  までの光路長の変化) が生じるような、対物光学系 2 を採用することが可能である。例えば、本実施形態のように、回転橈円鏡および回転放物面鏡等の回転曲面から形成される凹面鏡および凸面鏡を用いることで、上記のような対物光学系 2 を実現し得る。

#### 【0090】

このような対物光学系 2 に対し、制御部 30 は、測定光をラスタースキャンすることで、複数のスキャンラインにおける二次元 OCT データを取得してもよい。つまり、制御部 30 は、光スキャナ 27 を駆動制御することで、主走査によって取得される二次元 OCT データを、副走査の方向の異なるスキャンラインにおいて複数取得する。そして、第 2 スキャナの走査位置に応じて駆動機構 25a を駆動制御してもよい。つまり、第 2 スキャナの走査位置に応じて駆動機構 2 を駆動することで、参照光と測定光との光路長差の変化を補正してもよい。

10

20

30

40

50

## 【0091】

この場合において、副走査に伴って、測定光と参照光との光路長差に変化が生じ得るが、主走査と比べて、副走査のスピードは遅い。このため、光路長差の時間的な変化を抑制できる。よって、参照光と測定光との光路長差の変化がより確実に補正されるように、駆動機構25aを駆動させることができる。結果、複数の二次元OCTデータを良好に取得することができる。

## 【0092】

以上、実施形態に基づいて説明を行ったが、本開示は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が行われてもよい。

## 【0093】

例えば、第1実施例ないし第3実施例では、対物光学系2における第2ミラー60は回転橈円鏡であり、これと組み合わせて用いる第1ミラー50は、放物面鏡または双曲面鏡であった。換言すれば、第1実施例ないし第3実施例において、第1ミラー50は、離心率1となる2次曲線を対称軸周りに回転させた軌跡によって形成される曲面であった。しかし、前述したように、第1ミラー50、および、第2ミラー60の曲面形状は、それぞれ種々の二次曲面、或いは非球面から適宜選択されてもよい。

## 【0094】

例えば、上記実施形態において、走査光学系1は、それぞれに光スキャナを持つ、2つの撮影光学系（上記実施形態では、SLO光学系10と、OCT光学系20）の光路が、光路結合部40によって結合される場合を説明した。しかし、かならずしもこれに限られるものではなく、走査光学系1は、撮影光学系と、治療用または刺激用の光を発する照射光学系と、の光路が、光路結合部40によって結合されてもよい。ここでいう、撮影光学系は、撮影用の第1光源からの光を第1光スキャナを駆動することで、眼底上で走査させると共に、第1光源からの光の眼底反射光を受光する検出器と、を備えていてもよい。この場合、例えば、上記実施形態におけるSLO光学系10およびOCT光学系20のいずれかが撮影光学系として利用されてもよい。一方、照射光学系によって、被検眼Eに対し照射される光は、例えば、眼底で光凝固を行うための治療用レーザであってもよい。また、視野検査用の刺激光であってもよい。勿論、治療用または刺激用の光としては、これに限定されるものではない。このような照射光学系は、治療用又は刺激用の光を出射する第2光源からの光を偏向することで、眼底上における前記光の照射位置を定める第2光スキャナを少なくとも有してもよい。このような照射光学系は、上記実施形態におけるSLO光学系10およびOCT光学系20のいずれと置き換えられてよく、第2光スキャナは、上記実施形態における何れかの光スキャナ15, 27に置き換えられて、配置されてもよい。

## 【0095】

本開示には、ラインスキャンSLOで広角撮影を行う際に生じる種々の問題点への解決手段として、以下のような眼底撮影装置が、更に、開示されている。

## 【0096】

## (第1の眼底撮影装置)

光源から導かれたライン状の光を走査する光スキャナと、眼底反射光を受光するためのラインセンサ又はエリアセンサと、を持つラインスキャンSLO光学系と、前記光スキャナと前記被検眼との間に配置される対物光学系であって、被検眼が焦点に置かれる曲面鏡と、前記曲面鏡に前記光スキャナからの光を導くと共に、前記曲面鏡に起因する像面歪曲を打ち消す歪曲補正光学系と、を有する対物光学系と、を持つ眼底撮影装置。

## 【0097】

上記実施形態では、第2ミラー60（「曲面鏡」の一例）によって生じる像面歪曲が、第2ミラー60と光スキャナ15, 27との間に配置されるミラー（第1ミラー50と補正ミラー系71, 72との組み合わせ、または、第1ミラー50と補正ミラー171との組み合わせ）によって打ち消された（換言すれば、軽減された）。但し、歪曲補正光学系は、必ずしもミラーのような反射要素のみで形成される必要はない。例えば、一部または

10

20

30

40

50

全部に、レンズのような屈折要素が含まれていてもよい。屈折要素は、「曲面鏡」で生じる像面歪曲を軽減するものであればよい。具体的には、光軸に対して偏心配置されたレンズであってもよいし、非球面レンズであってもよいし、その他の構成であってもよい。

【0098】

(第2の眼底撮影装置)

第1の眼底撮影装置において、前記曲面鏡は、第1の焦点および第2の焦点を持ち、前記第1の焦点の共役位置に前記光スキャナが、前記第2の焦点に被検眼が、それぞれ配置される橢円鏡であり、前記歪曲補正光学系は、前記光スキャナと第1の焦点との間、又は、前記第1の焦点と前記第2の焦点との間に配置される。

【0099】

第2の眼底撮影装置において、光スキャナと第1の焦点との間に、歪曲補正光学系が配置される場合は、光スキャナが第1の焦点に配置されていてもよい。

【0100】

(第3の眼底撮影装置)

第1または第2の眼底撮影装置において、眼底および対物光学系とシャインブルーフの関係となるようにラインセンサ又はエリアセンサが傾斜配置される、又は、眼底反射光が前記対物光学系を経由することによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する。

【0101】

(第4の眼底撮影装置)

光源から導かれたライン状の光を走査する光スキャナと、眼底反射光を受光するためのラインセンサ又はエリアセンサと、を持つラインスキャンSLO光学系と、前記光スキャナと前記被検眼との間に配置される対物光学系であって、少なくとも1つの曲面鏡を持ち、光スキャナから導かれる光源からの光を、曲面鏡で反射することによって、前記曲面鏡の焦点に形成される前記光の旋回点を経由させて前記光を眼底に導く対物光学系と、を持ち、更に、眼底および対物光学系とシャインブルーフの関係となるようにラインセンサ又はエリアセンサが傾斜配置される、又は、眼底反射光が前記曲面鏡によって反射されることによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する、眼底撮影装置。

【0102】

(第5の眼底撮影装置)

第4の眼底撮影装置において、前記曲面鏡は、第1の焦点および第2の焦点を持ち、前記第1の焦点の共役位置に前記光スキャナが、前記第2の焦点に被検眼が、それぞれ配置される橢円鏡である。

【0103】

(第6の眼底撮影装置)

第5の眼底撮影装置において、前記対物光学系は、更に、前記曲面鏡に前記光スキャナからの光を導くと共に、前記曲面鏡に起因する像面歪曲を打ち消す歪曲補正光学系を持つ。

【0104】

(第7の眼底撮影装置)

第6の眼底撮影装置において、前記歪曲補正光学系は、前記光スキャナと第1の焦点との間、又は、前記第1の焦点と前記第2の焦点との間に配置される。

【0105】

(第8の眼底撮影装置)

第3または第4の眼底撮影装置において、ラインスキャンSLO光学系における光スキャナとラインセンサ又はエリアセンサとの間の眼底反射光の受光光路上であって、光源からの光の投光光路とは独立した光路上に、光学部材は配置される。

【符号の説明】

【0106】

1 走査光学系

2 対物光学系

10 SLO光学系

10

20

30

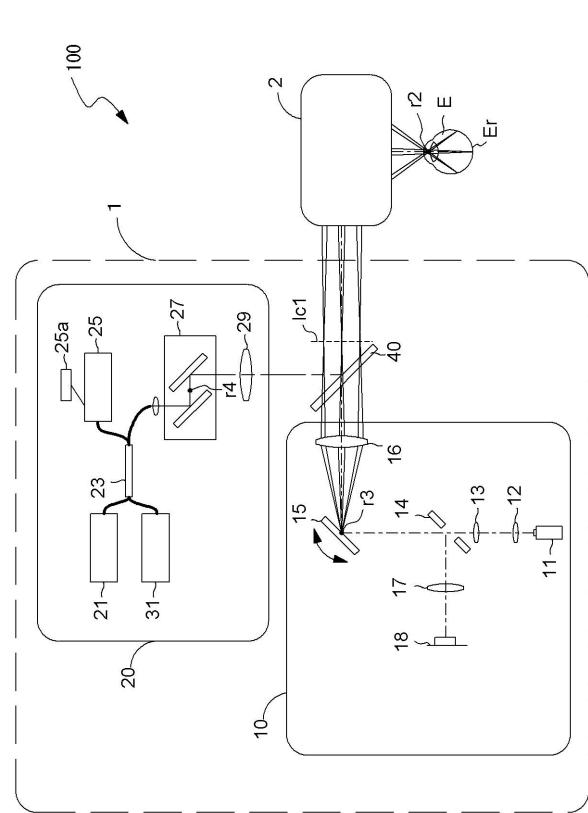
40

50

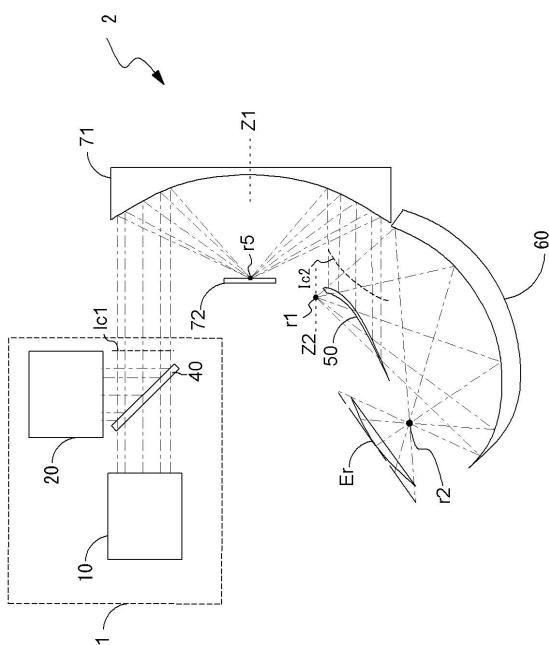
20 OCT光学系  
 11, 21 光源  
 15, 27 光スキャナ  
 18 検出器  
 40 光路結合部材  
 50 第1ミラー  
 60 第2ミラー  
 71, 72 補正ミラー系  
 100 眼底撮影装置  
 r1 第1旋回点  
 r2 第2旋回点  
 E 被検眼  
 Er 眼底

10

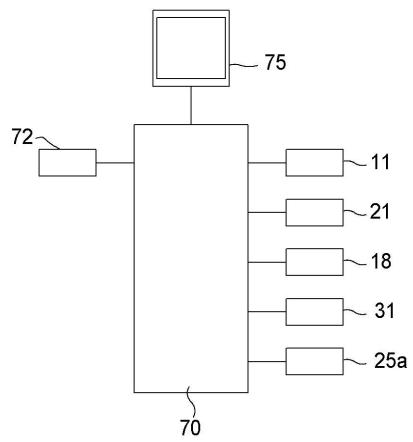
【図1】



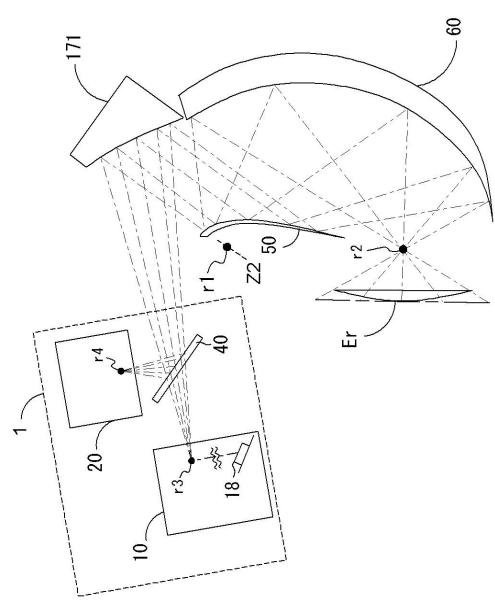
【図2】



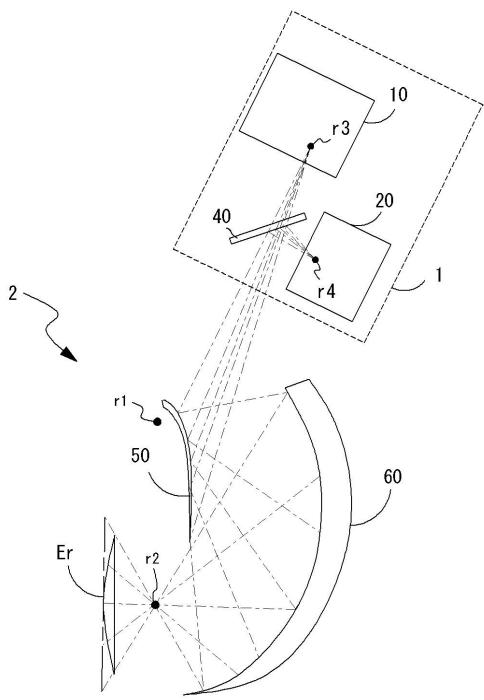
【図3】



【図4】



【図5】



---

フロントページの続き

(56)参考文献 特表2009-543585(JP,A)  
特表平03-500137(JP,A)  
特開2015-033423(JP,A)  
特表2013-524978(JP,A)  
特開2014-217756(JP,A)  
特開2000-126133(JP,A)  
国際公開第2014/053824(WO,A1)  
米国特許出願公開第2007/0030449(US,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A 61 B 3 / 00 - 3 / 18